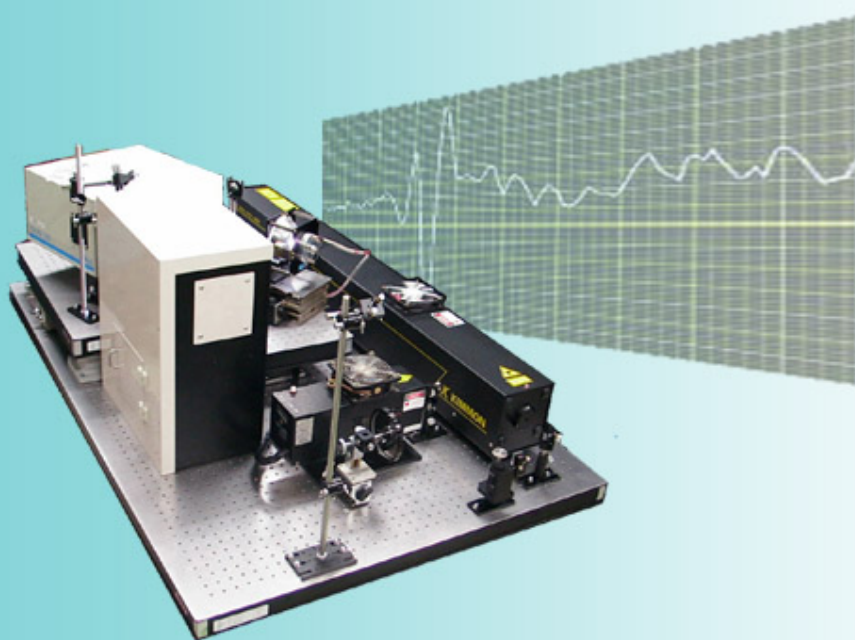


SELSHIN

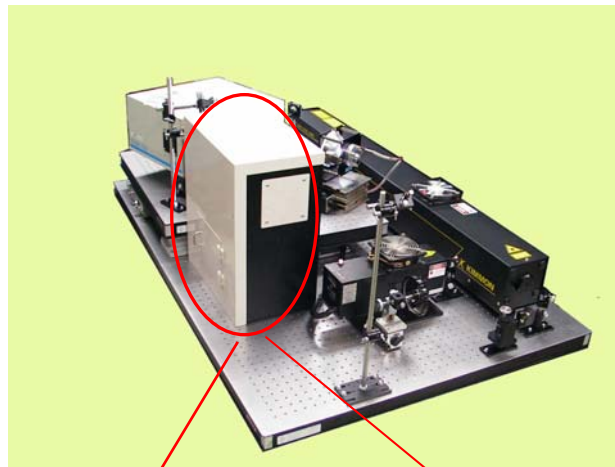


フォトリフレクタンス非破壊評価システム

フォトリフレクタンスシステムの特徴

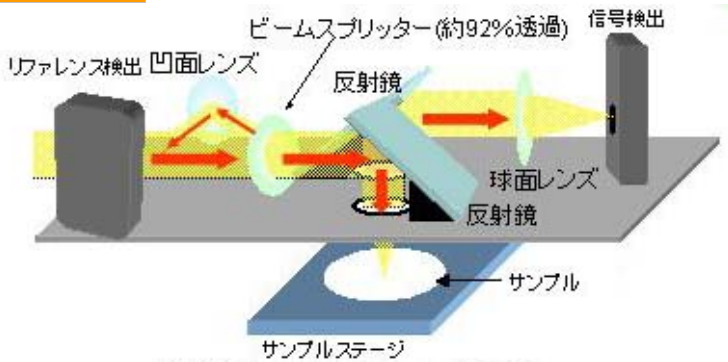
- 非破壊非接触測定
- ヘテロ接合界面の評価に最適
- ナイトライド半導体など発光しやすい半導体も独自の光学系により除去し、より正確な波長解析を実現
- 操作しやすい平置き設計と自動ステージとの組み合わせでマッピングが可能。マッピングによりバンドギャップ、半値幅、膜厚などプロセス評価に最適

光学系外観



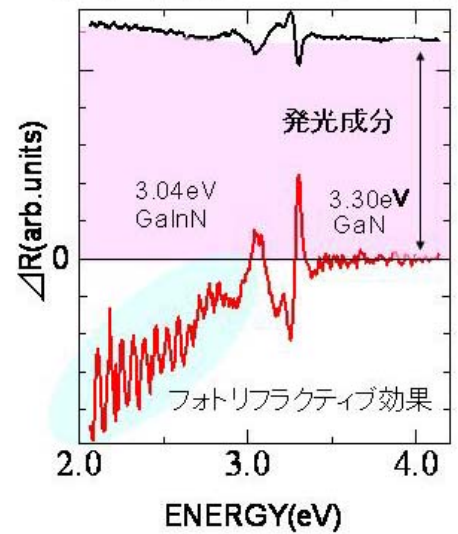
光源、レーザー、検出器などサンプルにあわせて選択いただけます。
(写真はXeランプ、He-Cdレーザー、Arレーザー搭載)

測定系内部



発光成分除去

改良前と改良後のPRスペクトルの比較



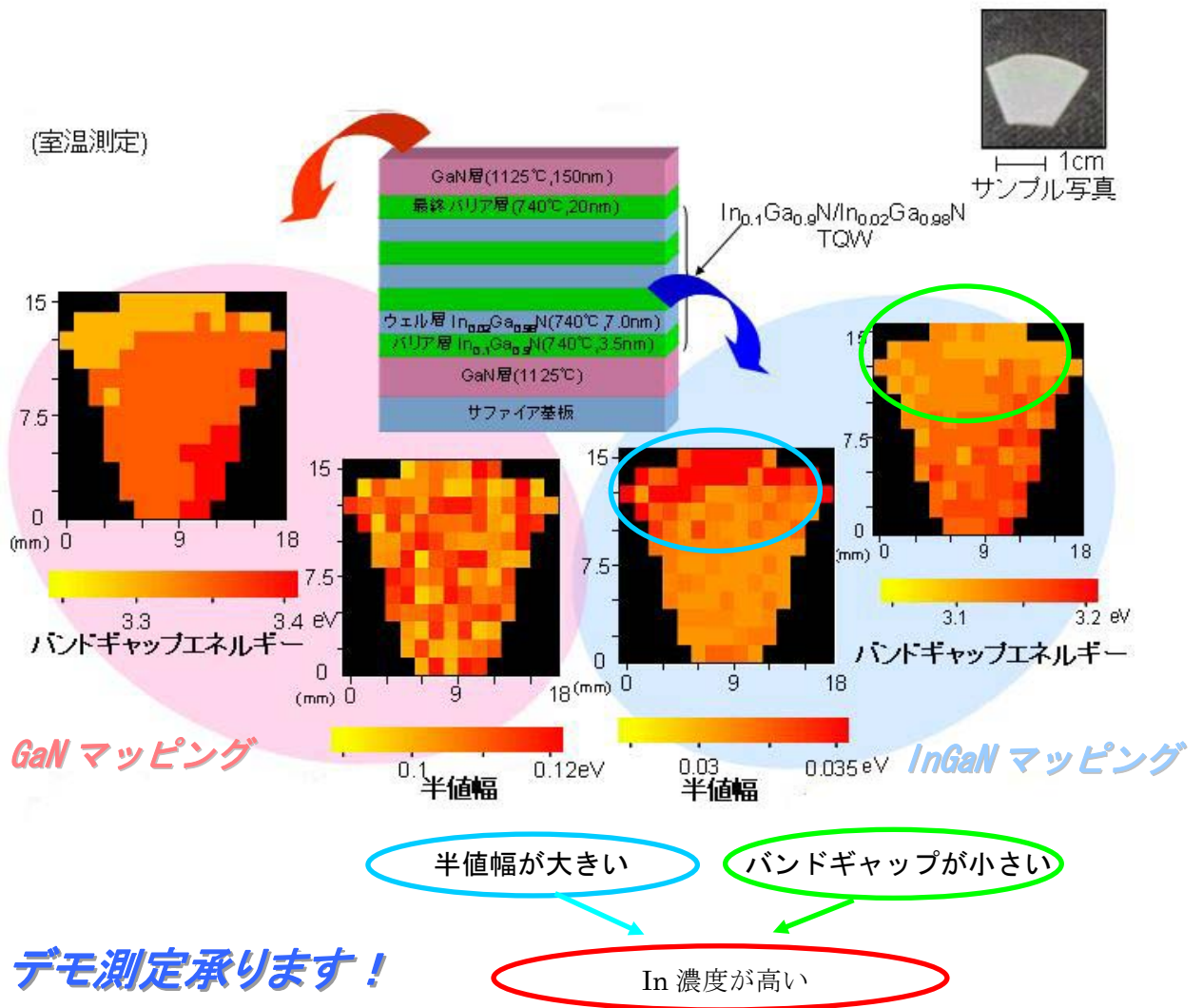
自動ステージ



平置きなのでウエハ、粉体のサンプルも安心してセッティングできます。

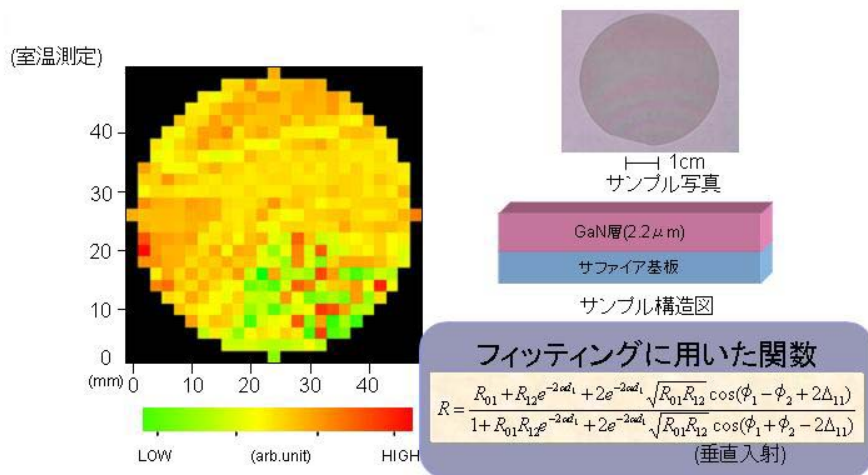
発光成分が除去されより詳細な測定が可能。埋もれていたフォトリフラクティブ効果も観測されました。

マッピング測定



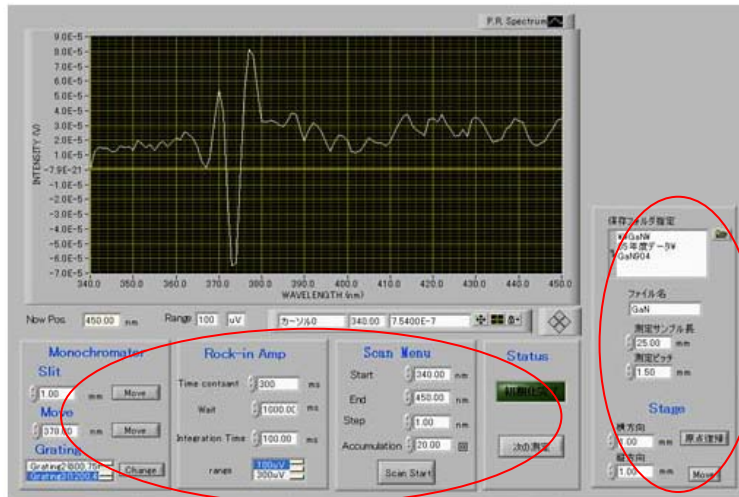
組成のばらつきや歪みの分布を可視化できます!!

マッピング測定 (膜厚)



本来、2.2 μmを目標に作製されたサンプルであるが表面に最大で300nm程度のゆらぎがみられる

測定画面



マッピング条件設定

測定条件設定

条件設定からスペクトル表示まで一つの画面で操作ができます。

測定画面



リアルタイムの
フィッティングの結果

最適の
フィッティングの結果

スペクトルパラメータの設定
振幅、ファイル名など

解析条件の設定

※ データ提供 神戸大学 工学部 喜多研究室

デモ測定、お問合せは下記までご連絡ください。

TEL 078-391-5391 E-mail k_hirokawa@seishin-syoji.co.jp 担当 弘川

製造・販売元

西進商事株式会社

本社	〒650-0021	神戸市中央区三宮町 1-2-1	TEL 078-391-5391	FAX 078-331-5735
東京支店	〒105-0012	東京都港区芝大門 2-12-7	TEL 03-3459-7491	FAX 03-3459-7499
名古屋営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南 1-24-30	TEL 052-586-4741	FAX 052-586-4796
北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北二条西 1-10	TEL 011-221-2171	FAX 011-221-2010